

Полуавтоматическая установка бесконтактного измерения удельного сопротивления NC-80Map

Полуавтоматическая установка бесконтактного измерения удельного сопротивления NC-80Map

Производитель:

Napson

Цена:

Цена по запросу

Описание

Измерения в данной установке реализованы на основе вихревых токов, возникающих в образце при помещении его в переменное магнитное поле. Измерения осуществляются полностью в автоматическом режиме, с заданием до 217 точек на поверхности и последующим формированием 2D/3D карты измерений. Возможна работа с круглыми подложками диаметром от 50 до 200 мм. Загрузка подложек осуществляется вручную. Возможность установки до 3 измерительных головок, позволяет покрыть большой диапазон измеряемых значений. Широкий спектр рабочих материалов, точность измерений в соответствии со стандартами ASTM, компактный дизайн, простота использования, автоматизация, позволяют использовать данную установку как в научно-исследовательских целях, так и на крупносерийном производстве.

Область применения:

- Полупроводниковые материалы, материалы солнечных элементов (Si, poly-Si, SiC и т.д.)
- Наноматериалы (углеродные нанотрубки, DLC, графен, серебряные нанопроволоки и т.д.)
- Тонкие проводящие пленки (металл, ITO, IZO т.д.)
- Эпитаксиальные слои, легированные образцы
- Сложные полупроводниковые материалы (GaAs, GaN, InP, GaSb и т.д.)

Технические характеристики:

Режим работы	Автоматический
Управление	Специализированное ПО и ПК

Размер образца	Ø50 - 200 мм Опция до 300 мм
Количество измерительных головок	До 3
Функция 2D/3D картографирования	Наличие
Диапазон измерения поверхностного сопротивления [Rs], в зависимости от измерительной головки	0,005 - 0,01 Ом/□ 0,01 - 0,5 Ом/□ 0,5 - 10 Ом/□ 10 - 1000 Ом/□ 1000 - 3200 Ом/□
Диапазон измерения удельного сопротивления [R], в зависимости от измерительной головки	0,001 - 0,05 Ом•см 0,05 - 0,5 Ом•см 0,5 - 60 Ом•см 60 - 200 Ом•см